

ZEISS AURIGA

RESUMEN

CATEGORÍA Microscopio Electrónico Dual Beam (FIB-SEM).

TÉCNICAS

- Microscopía electrónica de barrido
- FIB
- CrioSEM
- EDX
- EBSD

RESPONSABLES Francisco Varela // Juan Luis Ribas.

LOCALIZACIÓN Edificio CITIUS, Sótano, Ala Derecha.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Platina: motorizada en 6 ejes.
- Columna SEM (Gemini):
 - Fuente de electrones: cañón de emisión de campo tipo Schottky.
 - Resolución: 1,0 nm a 15 kV; 1,9 nm a 1 kV
 - Aumentos: de 12X a 1000kX
 - Corriente: de 4 pA a 20 nA
 - Voltaje de aceleración: de 0,1 a 30 kV
- Columna FIB (Cobra):
 - Fuente de iones: Galio líquido.
 - Resolución: 2,5 nm a 30 kV
 - Aumentos: de 300X a 500kX
 - Corriente: de 1 pA a 50 nA
 - Voltaje de aceleración: de 1 a 30 kV
- Detectores:
 - En cámara: SE Everhart-Thomley
 - En cámara: BSE
 - In lens: SE
 - In lens: EsB, con rejilla de filtrado para detección de BSE puros.

- Sistema de inyección de gases con 5 precursores.
- 2 cámaras CCD de infrarrojos para visualización de la muestra.
- Sistema de micromanipuladores.
- Sistema para realizar estudios en muestras congeladas:
 - Platina con control de temperatura.
 - Brazo de transferencia VCT100.
- Sistema de compensación local de carga (N₂ gas).